## PCT

#### WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C01B 31/02, B01J 19/08

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/55396

A1

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

10. Dezember 1998 (10.12.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP98/03399

(22) Internationales Anmeldedatum:

5. Juni 1998 (05.06.98)

(30) Prioritätsdaten:

97/07011

6. Juni 1997 (06.06.97)

FR

(71)(72) Anmelder und Erfinder: SCHWOB, Yvan [FR/FR]; Villa Melite, 14, allée du Parc St.-Jean, F-06400 Cannes (FR).

(74) Anwälte: WEINHOLD, Peter usw.; Winter Brandl & Partner, Alois-Steinecker-Strasse 22, D-85354 Freising (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

#### Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING FULLERENES

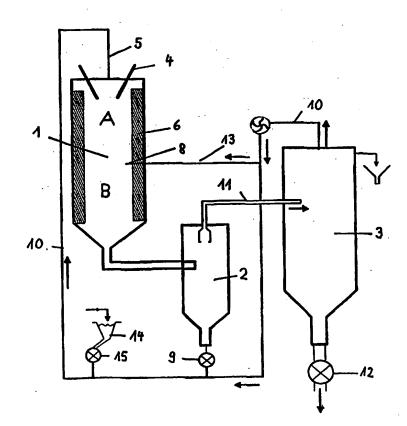
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON FULLERENEN

#### (57) Abstract

The invention relates to a method and a device for the continuous production of carbon black with a high fullerene content. The device essentially consists of a plasma reactor (1), a downstream heat separator (2) to separate the non-liquid constituents and a cold separator (3) attached thereto.

#### (57) Zusammenfassung

Es wird eine neue Vorrichtung und ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Rußen mit hohem Fullerenanteil beschrieben. Die Vorrichtung besteht im wesentlichen aus einem Plasmareaktor (1), einem nachgeschalteten Warmabscheider (2) zur Abscheidung von nicht flüchtigen Bestandteilen und einem daran anschließenden Kaltabscheider (3).



#### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

Albanien Armenien Osterreich Australien Aserbaidschan Bosnien-Herzegowina Barbaidos Belgien Rufwina Faso	es fi fr ga gb ge gh gn	Spanien Finnland Frankreich Gabun Vereinigtes Künigreich Georgien Ghana	LT LU LV MC MD MG	Litauen Luxemburg Lettland Monaco Republik Moldau	SK SN SZ TD TG	Slowakei Senegal Swasiland Tschad Togo
Osterreich Australien Aserbaidschan Bosnien-Herzegowina Barbados Belgien	FR GA GB GE GH	Gabun Vereinigtes Königreich Georgien Ghana	LV MC MD	Lettland Monaco Republik Moldau	SZ TD TG	Swasiland Tschad
Australieu Aserbaidschau Bosnien-Herzegowina Barbados Belgien	GA GB GE GH	Gabun Vereinigtes Königreich Georgien Ghana	MC MD	Monaco Republik Moldau	TD TG	Tschad
Aserbaidschaa Bosnien-Herzegowina Barbados Belgien	GB GE GH	Vereinigtes Königreich Georgien Ghana	MD	Republik Moldau	TG	
Bosnien-Herzegowina Barbados Belgien	GE GH	Georgien Ghana				Togo
Barbados Belgien	GH	Ghana	MG	No. decembers		
Belgien		<del>-</del>		Madagaskar	TJ	Tadachikistan
		Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
	GR			Republik Mazedonien	TR	Türkei
			ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
			MN	Mongolei	UA	Ukraine
— <del>-</del>			MR	Mauretanien	UG	Uganda
			MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
			MX	Mexiko		Amerika
	JP		NB	Niger	UZ	Usbekistan
			NL	Niederlande	VN	Vletnam
			NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
			NZ	Neusceland	zw	Zimbabwe
		<del>_</del>	PL	Polen		
	KR		PT	Portugal		
		•	RO	Rumānieo		
			RU	Russische Föderation		
-			SD	Sudan		
	Burkina Faso Bulgarien Benin Brasilien Bolarus Kanada Zentralafrikanische Republik Kongo Schweiz Côte d'Ivoire Kamerun China Kuba Tachechische Republik Deutschland Dänemark Estland	Burkina Faso GR Bulgarien HU Bealm IE Brasilien IL Belarus IS Kanada IT Zentralafrikanische Republik JP Kongo KE Schweiz KG Côte d'Ivoire KP Kamerun China KR Kuba KZ Tachechische Republik LC Deutschland LI Dänemark LK	Belgien GN Guinea  Burkina Faso GR Griechenland  Bulgarien HU Ungarn  Benlm IE Irland  Brasilien IL Israel  Belarus IS Island  Kanada IT Italien  Zontralafrikanische Republik JP Japan  Kongo KE Kenla  Schweiz KG Kirgisistan  Côte d'Twoire KP Demokratische Volksrepublik  Kamerun China KR Republik Korea  Kuba KZ Kasachstan  Tachechische Republik LC St. Lancia  Deutschland LI Liechtenstein  Danemark LK Griechtenstein	Belgien GN Guinea MK Burkina Faso GR Griechenland Bulgarien HU Ungarn ML Benin IE Irland MN Brasilien II. Israel MR Belarus IS Ialand MW Kanada IT Italien MX Zentralafrikanische Republik JP Japan NE Kongo KE Kenia NI Schweiz KG Kirgisistan NO Côte d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik NZ Kamerun KR Republik Korea PI Kuba KZ Kasachstan RO Tschechische Republik LC St. Lucia RU Deutschland LI Llechtensteln SD Dänemark LK Sri Lanka	Belgien GN Guinea MK Die chemalige jugoslawische Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonien Bulgarien HU Ungarn ML Mali Benlm IE Irland MN Mongolei Brasilien II Israel MR Mauretanien Belarus IS Ialand MW Malawi Makawi Kanada IT Italien MX Mexiko Zentralafrikanische Republik JP Japan NB Niger Kongo KE Kenla NI Niederlande Schweiz KG Kirgislstan NO Norwegen Côte d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik NZ Neusealand Kamerun KR Republik Korea PI Portugal Kuba KZ Kasachstan RO Rumānien Kumānien KZ Kasachstan RO Rumānien Tschechische Republik LC St. Lucia RU Russische Pöderation Dānemark LK Sri Lanka SE Schweden	Belgien GN Guinea MK Die ehemalige jugoslawische TM Burkina Faso GR Griechenland Republik Mazedonien TR Bulgarien HU Ungarn ML Mali TT Benlm IE Irland MN Mongolei UA Brasilien IL Israel MR Mamretanien UG Belarus IS Ialand MW Malawi US Kanada IT Italien MX Mexiko US Kanada IT Italien MX Mexiko UZ Kongo KE Kenia NI Niger UZ Kongo KE Kenia NI Niger UZ Kongo KE Kenia NI Niger UZ Côte d'Ivoire KP Demokratische Volkarepublik NZ Neusceland ZW Kamerun China KR Republik Korea PL Polen China KR Republik Korea PL Polen China KR Republik Korea PT Portugal Kuba KZ Kasachstan RO Rumānien SU Russische Pöderation Danemark LK Sri Lanka SE Schweden

WO 98/55396 PCT/EP98/03399

### Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Fullerenen

Die Erfindung beinhaltet eine Vorrichtung und ein Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Russen mit hohem Anteil an Fullerenen.

Unter Fullerenen werden im nachfolgenden molekulare, chemisch einheitliche und stabile Fullerene verstanden. Als Vertreter dieser Gruppe Fullerene seien Fulleren C<sub>60</sub>, C<sub>70</sub> oder C<sub>84</sub> genannt. Diese Fullerene sind in der Regel löslich in aromatischen Lösungsmitteln. Besonders bevorzugtes Fulleren ist das Fulleren C<sub>60</sub>.

5

10

15

20

Fraktionierungen erfordert.

Zur Herstellung von fullerenhaltigen Russen sind zahlreiche Verfahren bekannt. Die bisher erreichbare Konzentration an Fulleren in den erhaltenen Russen sind allerdings bescheiden, so dass eine Reindarstellung von Fullerenen nur mit sehr grossem Aufwand möglich ist. Durch den damit verbunden sehr hohen Preis der reinen Fullerene sind interessante Anwendungen auf verschiedenen Gebieten der Technik aus ökonomischen Gründen von vornherein nicht denkbar.

Beispielsweise sei auf die US-A 5,227,038 hingewiesen, worin eine Laboratoriumsvorrichtung beschrieben ist, die es ermöglicht, durch Einwirkung eines Lichtbogens zwischen als Rohstoff dienenden Kohleelektroden auf diskontinuierliche Weise einige Gramm Fullerene herzustellen. Abgesehen davon, dass die produzierten Mengen winzig sind, ist die Konzentration an Fulleren C<sub>60</sub> in den abgeschiedenen Kohlenstoffrussen selbst sehr gering und überschreitet niemals 10% der Produktmasse. Ausserdem liegt Fulleren C<sub>60</sub> bei diesem Verfahren als Gemisch mit höheren Fullerenverbindungen vor, was zur Isolierung in genügender Reinheit kostspielige

In der US-A 5,304,366 ist ein Verfahren beschrieben, das eine gewisse Konzentrierung des Produktes zulässt, aber ein System zum Filtrieren des Gaskreislaufes bei hoher Temperatur benutzt, was in der Praxis schwierig durchzuführen ist.

In der EP-B1 0 682 561 ist ein allgemeines Produktionsverfahren für Kohlenstoffrusse mit Nanostruktur beschrieben, welches durch die Einwirkung eines gasförmigen Plasmas auf Kohlenstoff bei hohen Temperaturen definiert ist. In einer der so erhaltenen Produktserien kann man bei ausreichenden Behandlungstemperaturen Fullerene auf kontinuierliche technische Weise erhalten.

Die gemäss dem Verfahren der EP-B1 0 682 561 austretenden Reaktionsprodukte sind indessen sehr unrein und enthalten wiederum bestenfalls 10 % Fulleren C<sub>60</sub> als Gemisch mit höheren Fullerenen neben nicht in Fullerene umgewandeltem Kohlenstoff.

Die Aufgabe der Erfindung bestand folglich darin, eine Vorrichtung und ein Verfahren zu entwickeln, das gestattet kontinuierlich Russe mit hohem Fullerenanteil herzustellen. Die Aufgabe konnte gelöst werden mit der erfindungsgemässen Vorrichtung gemäss Patentanspruch 1 und dem darauf aufbauenden Verfahren nach Patentanspruch 12.

#### Beschreibung der Figuren:

10

20

30

- Fig. 1 zeigt eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung, bestehend im wesentlichen aus Plasmareaktor (1) mit der ersten Reaktionskammer (A) und der zweiten Reaktionskammer (B), aus dem daran anschliessenden Warmabscheider (2) und dem daran anschliessenden Kaltabscheider (3).
- Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt aus dem Kopfteil des Plasmareaktors (1), umfassend im wesentlichen die erste Reaktionskammer (A).
  - Fig. 3 zeigt die Sicht von oben auf den Plasmareaktor (1), darstellend eine Ausführungsform der Erfindung mit drei im Winkel von 120° verteilten Elektroden (4), einer zentralen Zufuhreinrichtung (5) für das kohlenstoffhaltige Material und der hitzebeständigen und wärmeisolierenden Auskleidung (6).
  - Fig. 4 zeigt eine weitere Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung, die im wesentlichen aus denselben Bestandteilen wie Fig. 1 besteht, worin aber der Produktfluss im Plasmareaktor (1) entgegen der Schwerkraft verläuft.
- 25 Die erfindungsgemässe Vorrichtung besteht gemäss Patentanspruch 1 aus:
  - a) einem Plasmareaktor (1), der aus einer ersten Reaktionskammer (A) besteht, in welcher zwei oder mehrere Elektroden (4) eingelassen sind; die erste Reaktionskammer (A) ferner eine Zufuhreinrichtung (5) für das Plasmagas und die kohlenstoffhaltigen Verbindungen enthält, welche das Plasmagas und die kohlenstoffhaltigen Verbindungen zentral in die Reaktionszone leitet; der Plasmareaktor (1) eine der ersten Reaktionskammer (A)

WO 98/55396 PCT/EP98/03399

angrenzende, zweite Reaktionskammer (B) enthält, die über geeignete Einrichtungen zur Kühlung des aus der ersten Reaktionskammer (A) austretenden Reaktionsgemisches verfügt,

- 5 b) einer dem Plasmareaktor anschliessenden Warmabscheider (2) und
  - c) einem mit dem Warmabscheider verbundenen Kaltabscheider (3).
- Der Plasmareaktor (1) besteht zweckmässig aus einem zylinderförmigen Metallmantel der gegebenenfalls doppelwandig ausgelegt werden kann. In dieser Doppelwandung kann ein geeignetes Kühlmittel zirkulieren. Der Metallmantel kann ausserdem eine, in der Regel aus Graphit oder zusätzlich aus einer Keramikschicht bestehende, Isolation (6) vorgesehen sein. Die erste Reaktionskammer (A) ist für die Plasmareaktion bei sehr hohen Temperaturen vorbehalten.
- 15 Im Kopfteil der ersten Reaktionskammer (A) sind erfindungsgemäss zwei oder mehrere, bevorzugt drei, Elektroden (4) eingelassen. Die Elektroden sind zweckmässig winklig zur Achse so angeordnet, dass sie im oberen Teil der ersten Reaktionskammer (A) einen Schnittpunkt bilden und über Stopfbüchsen (7) individuell in der Richtung ihrer Achsen stufenlos verstellbar sind. Die Neigung zur Senkrechtachse liegt zweckmässig im Bereich von 15° bis 90°, jedoch in allen Fällen so, dass eine leichte Zündung des das Plasma erzeugenden Lichtbogens ermöglicht wird und eine maximale Stabilität des Plasmas garantiert ist. Von Vorteil sind die Elektroden (4) gleichmässig verteilt, entsprechend ergibt sich bei drei Elektroden ein Winkelabstand von 120°. Üblicherweise werden in der Fachwelt übliche Plasmaelektroden verwendet. Diese bestehen üblicherweise aus einem möglichst reinen Graphit in der Form von zylindrischen Stäben von in der Regel einigen Zentimetern Durchmesser. Gegebenenfalls enthält der Graphit weitere Elemente, die einen stabilisierenden

Effekt auf das Plasma haben.

Die Elektroden werden in der Regel mit Wechselspannung zwischen 50 und 500 Volt betrieben. Die zugeführte Energie bewegt sich üblicherweise im Bereich von 40 kW/h bis 150 kW/h. Eine geeignete Steuerung der Elektroden sorgt für eine gleichmässige und stabile Plasmazone. Die Elektroden werden ihrem Abbrand entsprechend automatisch nachjustiert.

- Die Zufuhreinrichtung (5) dient als Speisungsorgan sowohl für die kohlenstoffhaltigen Verbindungen als auch für das Plasmagas. Es kann dabei auf in der Fachwelt übliche Vorrichtungen zurückgegriffen werden, die eine gleichmässige Zufuhr ermöglichen. Die Zufuhr erfolgt zweckmässig zentral in die durch die Elektroden gesteuerte Plasmazone. Die zweite Reaktionskammer (B) verfügt über geeignete Einrichtungen zur wirksamen und gezielten Kühlung des aus der ersten Reaktionskammer (A) austretenden Reaktionsgemischs. In einer vorzugsweisen Ausführungsform kann dafür eine Zufuhreinrichtung (8) vorgesehen sein, die z. B. durch Zyklonwirkung eine geeignete Verteilung von z. B. Plasmagas oder gegebenenfalls einem anderen Kühlmittel erlaubt.
- Erfindungsgemäss wird das aus der zweiten Reaktionskammer (B) austretende
  Reaktionsgemisch dem Warmabscheider (2) zugeführt.

  Der Warmabscheider (2) ist zweckmässig in Form eines isolierten oder isotherm beheizbaren
  Zyklons ausgestaltet, welcher im unteren Teil eine Schleuse (9) zur Abtrennung der nicht
  flüchtigen Bestandteile, eine Leitung (10) zur Rückführung der nicht flüchtigen Bestandteile
  in den Plasmareaktor (1) sowie im oberen Teil eine Leitung (11) zur Überführung der
  flüchtigen Bestandteile in den Kaltabscheider (3) enthält.

  Die isotherme Beheizung des Zyklons kann durch übliche Massnahmen erreicht werden.
- Alternativ kann der Warmabscheider durch einen geeigneten hitzebeständigen Filter ersetzt werden. Ein solcher Filter kann z. B. aus hitzebeständigen Materialien wie aus poröser Keramik, einer Metallfritte oder einem Graphitschaum bestehen. Entsprechend dem Warmabscheider können nicht näher dargestellte Einrichtungen, die eine Rückführung der abgetrennten festen Bestandteile ermöglichen, sowie Leitungen, die eine Überführung der gasförmigen Bestandteile in den Kaltabscheider (3) gestatten, vorgesehen sein.

Dem Warmabscheider (2) ist ein Kaltabscheider (3) angeschlossen, welcher zweckmässig in Form eines kühlbaren Zyklons ausgestaltet ist und, welcher im unteren Teil eine Schleuse (12) zur Abtrennung der fullerenhaltigen Russe und im oberen Teil eine Leitung (10) zur Rückführung des Plasmagases in den Plasmareaktor (1) enthält.

Die Kühlung dieses Zyklons kann auf übliche Art und Weise z. B. über einen mit Kühlflüssigkeit gespiesenen Kühlmantel erfolgen.

10

20

In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungsgemässen Vorrichtung kann eine Leitung (13) für die Speisung der Kühleinrichtung der zweiten Reaktionskammer (B) aus der Leitung (10) abgezweigt sein.

Auch kann eine Eintragungsvorrichtung (14) für das kohlenstoffhaltige Material vorliegen, die gestattet, das kohlenstoffhaltige Material über eine Schleuse (15) in die Leitung (10) einzuspeisen.

- 15 Gegenstand der Erfindung ist im weiteren ein Verfahren zur Herstellung von Russen mit hohem Anteil an den eingangs genannten Fullerenen aus kohlenstoffhaltigen Verbindungen im Plasma mit Hilfe der vorstehend dargestellten erfindungsgemässen Vorrichtung.

  Insbesondere betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung von Russen mit hohem Anteil an Fulleren C<sub>60</sub>.
  - Zweckmässig wird die Temperatur des Plasmas so eingestellt, dass eine grösstmögliche Verflüchtigung des eingetragenen kohlenstoffhaltigen Materials erreicht wird. In der Regel beträgt die Temperatur im ersten Reaktionsraum (A) im Minimum 4000 °C.
- Als Plasmagas wird zweckmässig ein Edelgas oder ein Gemisch von verschiedenen Edelgasen verwendet. Bevorzugt wird Helium, gegebenenfalls im Gemisch mit einem anderen Edelgas verwendet. Die verwendeten Edelgase sollten so rein wie möglich sein.
- Als kohlenstoffhaltiges Material wird von Vorteil ein hochreiner Kohlenstoff verwendet, der möglichst frei ist von störenden und die Qualität der Fullerene negativ beeinflussenden Verunreinigungen.

Verunreinigungen wie z. B. Wasserstoff, Sauerstoff oder Schwefel verringern die Produktionsausbeute an Fullerenen und bilden unerwünschte Nebenprodukte. Andererseits verursacht jede gasförmige im Kreislauf des Herstellungszyklus vorhandene Verunreinigung eine Verminderung der Reinheit des Plasmagases und erfordert Zufuhr des Plasmagases in reiner Form, um die ursprüngliche Zusammensetzung aufrechtzuerhalten.

Allerdings ist es auch möglich, das Plasmagas direkt, im Kreislauf des Herstellungszyklus, einer Reinigung zu unterziehen.

Zweckmässig gelangen hochreine feingemahlene Kohlenstoffpulver vom Typ Acetylenruss, Graphitpulver, Russe, gemahlene pyrolytische Graphite oder hochkalcinierte Kokse oder Gemische der genannten Kohlenstoffe zum Einsatz. Um eine optimale Verdampfung im Plasma zu erzielen, sind die genannten Kohlenstoffpulver bevorzugt möglichst fein. Gröbere Kohlenstoffteilchen können unter Umständen unverdampft die Plasmazone passieren. In diesem Fall kann eine Vorrichtung gemäss Figur 4, worin die Kohlenstoffteilchen der Schwerkraft

15

5

10

Das kohlenstoffhaltige Material wird zweckmässig zusammen mit dem Plasmagas über die Zufuhreinrichtung (5) in den Plasmareaktor gespiesen.

Das Plasmagas enthält das kohlenstoffhaltige Material zweckmässig in einer Menge von 0.1 kg/m³ bis 5 kg/m³.

entgegengesetzt in die Plasmazone gelangen, Abhilfe schaffen.

20

25

30

Das in der ersten Reaktionskammer (A) gebildete Reaktionsgemisch wird wie oben bereits erwähnt in der zweiten Reaktionskammer (B) mit genügender Wirksamkeit gektihlt, um es für einen definierten Zeitraum von in der Regel Bruchteilen einer Sekunde bis zu einer Sekunde auf einer Temperatur von zweckmässig zwischen 1000 °C und 2700 °C zu halten. In dieser Phase rekombinieren sich die aus der ersten Reaktionskammer (A) austretenden gasförmigen Kohlenstoffmolektile zu den eingangs genannten Fullerenen.

Die Kühlung erreicht man, wie oben dargestellt, mit geeigneten Kühleinrichtungen, bevorzugt durch gleichmässige Verteilung einer definierten Menge von kaltem Plasmagas in die zweite Reaktionskammer (B). Dieses kalte Plasmagas wird zweckmässig aus rezirkulierten Plasmagas gewonnen.

10

Am Austritt der zweiten Reaktionskammer (B) besteht das Gemisch in der Regel aus Plasmagas, gewünschtem Fulleren im gasförmigen Zustand, aus einem Teil des nicht umgewandelten Rohstoffes und aus nicht verdampfbaren Fullerenen.

- Im Warmabscheider (2), der, wie oben dargestellt, als Zyklon ausgestaltet ist, werden durch die Zyklonwirkung die festen Anteile von den gasförmigen Anteilen getrennt. Das gewünschte Fulleren, das selbst flüchtig, ist kann folglich mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90% von den übrigen nicht flüchtigen Kohlenstoffverbindungen getrennt werden.
  - Den Warmabscheider (2) hält man durch bekannte Mittel isotherm auf einer Temperatur von zweckmässig 600 °C bis 1000 °C, um jegliche Kondensation vom gewünschten Fulleren in irgendeinem ihrer Teile zu vermeiden.
  - Eine Schleuse (9) am Boden des Warmabscheider (2) ermöglicht es, den nicht in gewünschtes Fulleren umgewandelten Kohlenstoff z. B. mit Hilfe eines Gebläses in den geschlossenen Gaskreislauf kontinuierlich zurückzuführen.
- Der obengenannte und aber nicht näher dargestellte Filter vermag dieselbe Funktion wie der vorstehend dargestellte Warmabscheider (2) zu erfüllen.
  - Dem Warmabscheider (2) folgt der Kaltabscheider (3). Dieser wird durch beliebige bekannte Mittel auf eine Temperatur, die zur Kondensation des gewünschten Fullerens ausreicht, zweckmässig auf eine Temperatur von Raumtemperatur bis 200 °C gekühlt.
- 20 Am Austritt des Kaltabscheiders (3) sammelt sich in der Regel ein pulverförmiges Material, das aus einem Russ mit einem Anteil an gewitnschtem Fulleren von bis zu 40% enthält.
  - Dank der Schleuse (12) kann der mit dem gewünschten Fulleren angereicherte Russ dem Verfahren entnommen und der weiteren Reinigung zugeführt werden. Die weitere Reinigung kann dabei nach bekannten Verfahren, z. B. durch Extraktion (Dresselhaus et al., Science of
- Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press, 1996, Chapter 5, 111 ff., insbesondere chapter 5.2 und chapter 5.3), erfolgen.
  - Das aus dem Kaltabscheider (3) austretende Plasmagas kann z. B. über ein Gebläse über die Leitung (10) in den Plasmareaktor (1) zurückgeführt werden.
- Eine Abzweigung (13) von dieser Leitung (10) ermöglicht die Rückführung eines Teils des kalten Stroms in den zweiten Reaktionsraum (B) zwecks Kühlung des Reaktionsgemisches.

WO 98/55396 PCT/EP98/03399

Die nachfolgenden Beispiele verdeutlichen den Gegenstand der Erfindung ohne diesen jedoch auf den Umfang der Beispiele zu beschränken.

gehalten wurde, überführt.

#### Beispiele:

#### Beispiel 1

- Die Vorrichtung besteht aus einem zylindrischen Reaktor mit einem Innendurchmesser von 300 mm, einer Höhe von 150 cm und einem Doppelkühlmantel mit Wasserumlauf. Zwischen der Graphitauskleidung und der Innenwand der Druckkammer ist eine Isolierschicht aus Graphitschaum angeordnet. Drei Graphitelektroden mit einem Durchmesser von 20 mm sind mittels einer Gleitvorrichtung durch die Reaktorhaube hindurch mit Hilfe von in elektrisch isolierten Hülsen eingesetzten Stopfbüchsen positioniert. Eine zentrale Leitung mit einem Durchmesser von 3 mm dient der Einführung der Graphitsuspension in das plasmagene Gas. Das Plasmagas ist reines im Kreislauf geführtes Helium.

  Die Elektroden werden mit Wechselspannung so versorgt, dass die zugeführte Leistung 100 kw/h beträgt.
- 15 Mit einem Dreiphasenregler der in Lichtbogenöfen verwendeten Art wird eine relative Konstanz der elektrischen Eigenschaften auf dem Plasmaniveau sichergestellt. In der Reaktionskammer A wird so eine Plasmatemperatur von ca. 5000 °C gehalten.

  Die Reaktionskammer B wird mit kaltem zurückgeführtem Gas versorgt, um dessen Temperatur auf einem Wert von ca. 1600 °C zu halten.
- Der Rohstoff ist mikronisierter Graphit vom Typ TIMREX <sup>®</sup> KS 6 der Timcal AG, CH-Sins. Mit einer Gasmenge von 10 m³/h auf der Höhe des Reaktoreingangs und einem Stoffzusatz von 10 kg/h stellt sich nach einer Stunde Laufzeit ein permanenter Zustand ein. Im Warmabscheider (2), der auf einer Temperatur von 800 °C gehalten wird, wurden über die Schleuse (9) 8 kg/h nicht flüchtige Kohlenstoffverbindungen abgetrennt und zurückgeführt. Es wurde gefunden, dass ca. 6% des eingeführten Kohlenstoffs unter diesen Bedingungen in gasförmiges Fulleren C60 umgewandelt wurde. Mit einem Wirkungsgrad des Warmabscheiders von ca. 90% war das Fulleren C60 zu einem kleinen Teil mit nicht flüchtigen Kohlenstoffverbindungen und Helium vermischt. Dieses Aerosol wurde dem Kaltabscheider (3), der auf einer Temperatur von 150 °C

10

Das sich am Boden des Kaltabscheiders (3) ansammelnde Produkt wurde bei stabilem Betrieb in einer Menge von 2 kg/h aus der Schleuse (12) ausgetragen und bestand aus 30% Fulleren C<sub>60</sub> als Gemisch mit nicht umgesetzten Kohlenstoffen.

Das erhaltene Produkt kann in diesem Zustand verwendet werden, wurde aber gemäss

Dresselhaus et al., Science of Fullerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press, 1996, Chapter
5, 111 ff., insbesondere chapter 5.2 und chapter 5.3, durch Extraktion mit Toluol weiter
gereinigt. Die beispielgemässe Produktion erlaubt die Herstellung von 0,6 kg/h reinem Fulleren

C<sub>60</sub>.

10

15

25

5

#### Beispiel 2

Das Verfahren gemäss Beispiel 1 wurde wiederholt, lediglich Helium wurde durch Argon ersetzt. Unter diesen Bedingungen konnte nach Reinigung reines Fulleren C<sub>60</sub> mit einer Stundenleistung von 0,4 kg erhalten werden.

### Beispiel 3

20 Das Verfahren gemäss Beispiel 1 wurde wiederholt, lediglich der Warmabscheider (2) wurde durch einen Filter aus poröser Keramik ersetzt.

Der aus dem Filter austretende und in den Kaltabscheider (3) eintretende Gasstrom bestand nur noch aus mit gasförmigen Fullerenen C<sub>60</sub> beladenem Helium. Der Wirkungsgrad des Filters betrug ca. 90%. Nach diesem Verfahren konnte nach Reinigung reines Fulleren C<sub>60</sub> mit einer Stundenleistung von 0,6 kg erhalten werden.

#### Beispiel 4

Das Verfahren gemäss Beispiel 1 wurde wiederholt, lediglich der mikronisierte Graphit wurde durch einen hochreinen Acetylenruss der Firma SN2A, F- Berre l'Etang, ersetzt. Nach diesem

Verfahren konnte nach Reinigung reines Fulleren C<sub>60</sub> mit einer Stundenleistung von 0,8 kg erhalten werden.

## 5 Beispiel 5

10

Das Verfahren gemäss Beispiel 1 wurde wiederholt, lediglich der mikronisierte Graphit wurde durch einen hochreinen entgasten pyrolytischen Graphit des Typs ENSACO Super P der Firma MMM-Carbon, B-Brüssel, ersetzt. Nach diesem Verfahren konnte nach Reinigung reines Fulleren C<sub>60</sub> mit einer Stundenleistung von 0,7 kg erhalten werden.

#### Patentansprüche:

15

25

- Vorrichtung zur kontinuierlichen Herstellung von Russen mit hohem Fullerenanteil aus kohlenstoffhaltigen Verbindungen im Plasma bestehend aus
- a) einem Plasmareaktor (1), der aus einer ersten Reaktionskammer (A) besteht, in welcher zwei oder mehrere Elektroden (4) eingelassen sind, die erste Reaktionskammer (A) ferner eine Zufuhreinrichtung (5) für das Plasmagas und die kohlenstoffhaltigen Verbindungen enthält, welche das Plasmagas und die kohlenstoffhaltigen Verbindungen zentral in die Reaktionszone leitet,der
   Plasmareaktor (1) eine der ersten Reaktionskammer (A) angrenzende zweite Reaktionskammer (B) enthält, die über geeignete Einrichtungen zur Kühlung des aus der ersten Reaktionskammer (A) austretenden Reaktionsgemisches verfügt,
  - b) einem dem Plasmareaktor (1) anschliessenden Warmabscheider (2) und
  - c) einem mit dem Warmabscheider (2) verbundenen Kaltabscheider (3).
  - 2. Vorrichtung nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasmareaktor (1) mit einer hitzebeständigen und wärmeisolierenden Auskleidung (6) versehen ist.
- Vorrichtung nach Patentanspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Auskleidung (6)
   aus Graphit besteht.
  - 4. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder mehrere Elektroden (4) winklig zur Achse so angeordnet sind, dass sie im oberen Teil der ersten Reaktionskammer (A) einen Schnittpunkt bilden und über in die erste Reaktionskammer eingelassenen Stopfbüchsen (7) individuell in der Richtung ihrer Achsen stufenlos verstellbar sind.
  - Vorrichtung nach Patentanspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass drei mit Dreiphasenwechselspannung betriebene Elektroden (4), die aus Graphit bestehen, eingesetzt sind.

WO-98/55396 PCT/EP98/03399

- 6. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass als Einrichtung zur Kühlung eine Zufuhreinrichtung (8) für Plasmagas vorgesehen ist.
- 7. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Warmabscheider (2) in Form eines isotherm beheizbaren Zyklons ausgestaltet ist, welcher im unteren Teil eine Schleuse (9) zur Abtrennung der nicht flüchtigen Bestandteile und eine Leitung (10) zur Rückführung der nicht flüchtigen Bestandteile in den Plasmareaktor (1) enthält, sowie im oberen Teil eine Leitung (11) zur Überführung der flüchtigen Bestandteile in den Kaltabscheider (3) enthält.

8. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Warmabscheider (2) in Form eines wärmebeständigen Filters ausgestaltet ist.

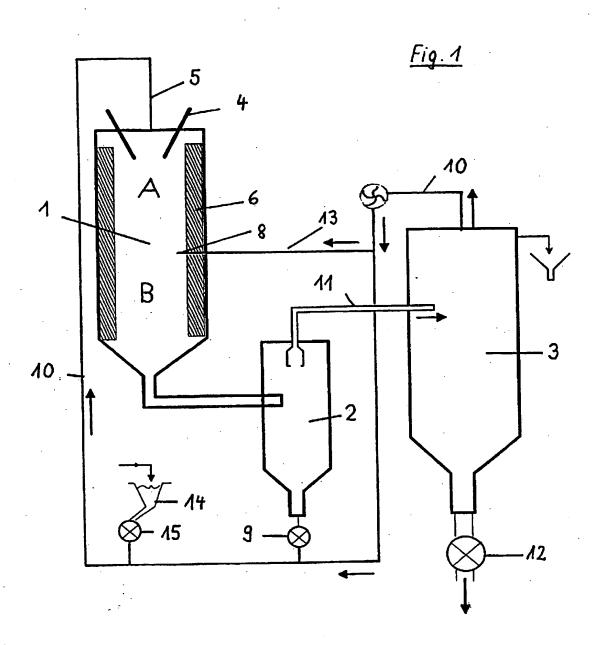
10

- 9. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltabscheider (3) in Form eines kühlbaren Zyklons ausgestaltet ist, welcher im unteren Teil eine Schleuse (12) zur Abtrennung der Fulleren haltigen Russe und im oberen Teil eine Leitung (10) zur Rückführung des Plasmagases in den Plasmareaktor (1) enthält.
- 10. Vorrichtung nach Patentanspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass aus der Leitung (10),
   20 welche zur Rückführung des Plasmagases in den Plasmareaktor (1) vorgesehen ist, eine Leitung (13), welche als Zuführung des Plasmagases in die zweite Reaktionskammer (B) vorgesehen ist, abzweigt.
- 11. Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass eine
  25 Eintragungsvorrichtung (14) für das kohlenstoffhaltige Material vorliegt, die gestattet,
  das kohlenstoffhaltige Material über eine Schleuse (15) in die Leitung (10) einzuspeisen.
- 12. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung von Russen mit hohem Anteil an Fullerenen, dadurch gekennzeichnet, dass kohlenstoffhaltigen Verbindungen im Plasma in der
   30 Vorrichtung nach einem der Patentansprüche 1 bis 11 umgewandelt werden.

15

- 13. Verfahren nach Patentanspruch 12. dadurch gekennzeichnet, dass chemisch einheitliche stabile Fullerene hergestellt werden.
- 14. Verfahren nach Patentanspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass Fulleren C<sub>60</sub>,
   5 C<sub>70</sub> oder C<sub>84</sub> oder Gemische dieser Fullerene hergestellt werden.
  - Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Plasmatemperatur im ersten Reaktionsraum A im Minimum ca. 4000 °C beträgt.
- 16. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Plasmagas ein Edelgas oder ein Gemisch von verschiedenen Edelgasen verwendet wird.
  - Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass als Plasmagas Helium verwendet wird.
  - 18. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass als kohlenstoffhaltiges Material ein hochreiner Kohlenstoff vom Typ Acetylenruss, Graphitpulver, Russe, gemahlene pyrolytische Graphite oder hochkalcinierter Koks oder Gemische der genannten Kohlenstoffe verwendet werden.
    - 19. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur in der zweiten Reaktionskammer (B) auf einer Temperatur von 1000 °C bis 2700 °C gehalten wird.
- 25 20. Verfahren nach Patentanspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Temperatur in der zweiten Reaktionskammer (B) durch Zufuhr von kühlem Plasmagas aus der Zufuhreinrichtung (8) reguliert wird.
- 21. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Warmabscheider (2) isotherm auf einer Temperatur von 600 °C bis 1000 °C gehalten wird.

- 22. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltabscheider (3) bei einer Temperatur von Raumtemperatur bis 200 °C betrieben wird.
- 23. Verfahren nach einem der Patentansprüche 12 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass ein Russ mit einem hohen Anteil an Fulleren C<sub>60</sub> hergestellt wird.



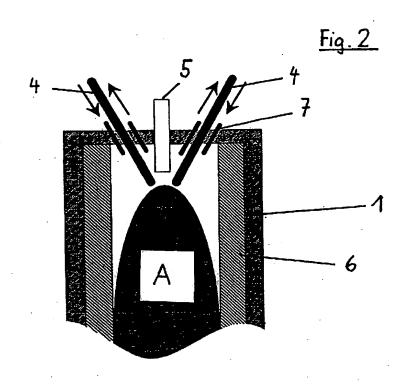
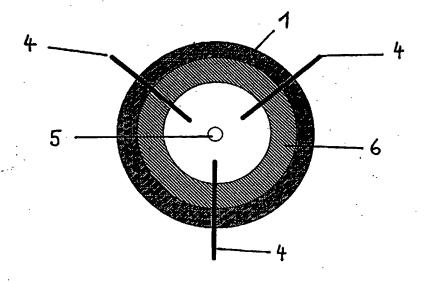
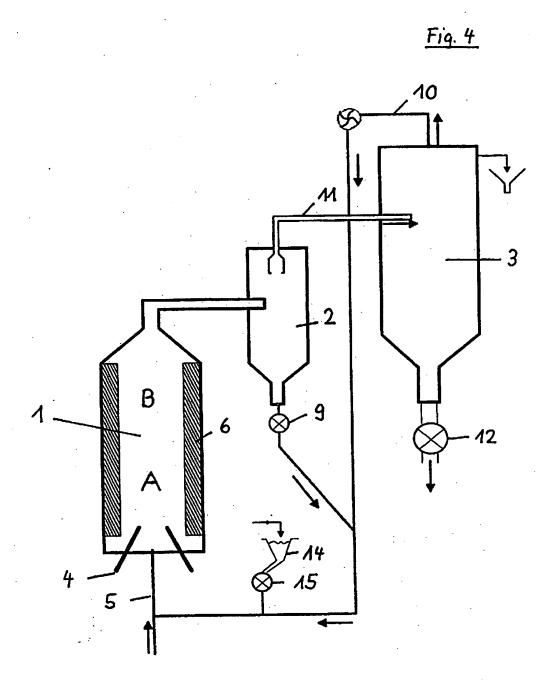


Fig. 3





#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern el Application No PCT/EP 98/03399

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 C01B31/02 B010 B01J19/08 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 C01B B01J Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. **WO 94 17908 A (ARMINES ;LONZA G & T AG** 1-5 (CH); SCHWOB YVAN (FR); FISCHER FRANCIS 12-17,23(C) 18 August 1994 see the whole document & EP 0 682 561 A cited in the application WO 94 04461 A (MAT & ELECTROCHEM RES CORP) 1,12-14,3 March 1994 16-18,23 see claims 1-101 see page 2, line 26 - page 3, line 6 see claims 1,2 see page 4, 1ine 3 - page 5, 1ine 23 Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are fisted in annex. Special categories of cited documents: "T" later document published efter the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cled to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular retevance Invention "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filling date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publicationdate of another citation or other special reason (as specified) document of particular relevance; the claimed invention carnot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the ert. "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of theirsternational search Date of mailing of the international search report 13 October 1998 20/10/1998 Name and mailing address of the ISA Authorized officer European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Rigondaud, B

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern :al Application No PCT/EP 98/03399

0.10		EP 98/03399
Category *	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT  Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Refevent to claim No.
<b>A</b>	EP 0 527 035 A (MITSUBISHI CHEM IND) 10 February 1993 see examples 1-5 see figure 1 see claims 1,2,6-8,10	1,12-14, 16-18,23
A	DE 43 02 144 A (LIPPRANDT MICHAEL DIPL ING ;GLUECK RALF (DE); BEHRENS MANFRED (DE)) 28 July 1994 see the whole document	. 1
A	DE 42 43 566 A (HOECHST AG) 23 June 1994 see the whole document	1
A	WO 86 02024 A (UNIV MINNESOTA) 10 April 1986	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

...ormation on patent family members

PCT/EP 98/03399

			PCI/EP 98/03399			
Patent document cited in search report		Publication date	Patent tamily member(s)		Publication date	
WO 9417908	A	18-08-1994	FR	2701267 A	12-08-1994	
			AT	141184 T	15-08-1996	
			AU	6001994 A	29-08-1994	
			CA	2154482 A	18-08-1994	
			DE	59400498 D	19-09-1996	
			DK	682561 T	02-09-1996	
			EP	0682561 A	22-11-1995	
			ES	2091136 T	16-10-1996	
			JP	9505551 T	03-06-1997	
			NO	953066 A	04-08-1995	
				933000 A		
WO 9404461	A	03-03-1994	AU	678393 B	29-05-1997	
			AU	5011393 A	15-03-1994	
			CA	2142307 A	03-03-1994	
•			EP	0656870 A	14-06-1995	
			JP	8500079 T	09-01-1996	
EP 0527035	- A	10-02-1993	JP	5124807 A	21-05-1993	
			ĎĖ	69202419 D	14-06-1995	
•			DE	69202419 T	05-10-1995	
DE 4302144	A	28-07-1994	W0	9416993 A	04-08-1994	
DE 4243566	A	23-06-1994	AT	153004 T	15-05-1997	
		*	AU	5697694 A	19-07-1994	
•			DE	59306472 D	19-06-1997	
		•	DK	675853 T	08-12-1997	
			- WO	9414704 A	07-07-1994	
•			EP	0675853 A	11-10-1995	
	- 		ES ·	2105612 T	16-10-1997	
WO 8602024	Α .	10-04-1986	CA	1244526 A	08-11-1988	
	-		- EP	0195052 A	24-09-1986	
		•	ĴΡ	62500290 T	05-02-1987	
•		•	ÜS	4818837 A	04-04-1989	
			ÜŠ	RE32908 E	18-04-1989	
•			US	4725447 A	16-02-1988	

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern .ales Aktenzeichen
PCT/EP 98/03399

		PCT/EP 98	/03399
A. KLASSI IPK 6	FIZIERUNG DES AMMELDUNGSGEGENSTANDES C01B31/02 B01J19/08		
			·
Nach der Int	iamationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass	ifikation und deriPK	
	RCHIERTE GEBIETE rer Mindestprüstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol		
IPK 6	CO1B BO1J	• 1	
Recherohler	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	veit diese unter die recherchierten Gebiete	fallen
	•		
Während de	er internationalen Recherche konsuftierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		<u> </u>
Kategorie*	Bezeichnung der Veröftentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 94 17908 A (ARMINES ;LONZA G & (CH); SCHWOB YVAN (FR); FISCHER F (C) 18. August 1994 siehe das ganze Dokument & EP 0 682 561 A		1-5, 12-17,23
A	in der Anmeldung erwähnt WO 94 04461 A (MAT & ELECTROCHEM 3. März 1994 siehe Ansprüche 1-101	•	1,12-14, 16-18,23
	siehe Seite 2, Zeile 26 - Seite 3 siehe Ansprüche 1,2 siehe Seite 4, Zeile 3 - Seite 5,		
	• .		
		•	
	itere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu nehmen	X Siehe Anhang Patentiamille	
"A" Veröffe aber i aber i alteres Anme "L" Veröffe ande soll o ausgr "O" Veröffe eine l"p" Veröffe	entlichtung, die den eitgemeinen Stand der Technik definiert, nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist I Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen skledatum veröffentlicht worden ist pritichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsanspruch zwelfelhaft er- lnen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	T" Spätere Veröffentlichung, die nach der oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Ameidung nicht kollidiert, sondern ni Erfindung zugrundellegenden Prinzip Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedkann allein aufgrund dieser Veröffentlichung von besonderer Bedkann nicht als auf erlinderischer Täligwerden, werm die Veröffentlichung m Veröffentlichung mit Veröffentlichung für einen Fachman diese Verbindung für einen Fachman "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselbe	ht worden ist und mit der ur zum Verständnie dee der s oder der ihr zugrundellegenden butung; die beanspruchte Erfindung lichung nicht als neu oder auf rachtet werden sultung; die beanspruchte Erfindung jael beruhend betrachtet it einer oder mehreren anderen n Verbindung gebracht wird und in nahellegend ist
Datum des	a Abschlusses der Internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen R	echerchenberichts
1	13. Oktober 1998	20/10/1998	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehärde Europäisches Patentami, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	Bevoltmächligter Bedlensteter	
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo rd, Fax: (+31-70) 340-3016	Rigondaud, B	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Interna eles Aktenzeichen
PCT/EP 98/03399

		PCT/EP 98	/03399	
	ing) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		15.5.4	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit enforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Tequ	Betr. Anspruch N	ir.
A	EP 0 527 035 A (MITSUBISHI CHEM IND) 10. Februar 1993 siehe Beispiele 1-5 siehe Abbildung 1 siehe Ansprüche 1,2,6-8,10		1,12- 16-18	14, ,23
<b>A</b>	DE 43 02 144 A (LIPPRANDT MICHAEL DIPL ING ;GLUECK RALF (DE); BEHRENS MANFRED (DE)) 28. Juli 1994 siehe das ganze Dokument		1	
A	DE 42 43 566 A (HOECHST AG) 23. Juni 1994 siehe das ganze Dokument		1	
A	WO 86 02024 A (UNIV MINNESOTA) 10. April 1986	•		
		•		
			1.	
ļ				

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichung..., die zur seiben Patentfamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/EP 98/03399

Im Recherchenbe	dcht	Datum der	PCT/EP 98/03399		
angeführtes Patentdokument		Veröffentlichung		/litglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9417908	Α	18-08-1994	FR	2701267 A	12-08-1994
			AT	141184 T	15-08-1996
			AU	6001994 A	29-08-1994
			CA	2154482 A	18-08-1994
	*		DE	59400498 D	19-09-1996
			ÐK	682561 T	02-09-1996
			EP	0682561 A	22-11-1995
			E\$	2091136 T	16-10-1996
			JP	9505551 T	03-06-1997
			NO	953066 A	04-08-1995
WO 9404461	Α	03-03-1994	AU	678393 B	29-05-1997
			AU	5011393 A	15-03-1994
			CA	2142307 A	03-03-1994
		•	EP	0656870 A	14-06-1995
			JP	8500079 T	09-01-1996
EP 0527035	Α	10-02-1993	JP	5124807 A	21-05-1993
			DE	69202419 D	14-06-1995
			DE	69202419 T	05-10-1995
DE 4302144	Α -	28-07-1994	WO	9416993 A	04-08-1994
DE 4243566	A	23-06-1994	AT	153004 T	15-05-1997
		•	AU	5697694 A	19-07-1994
		•	DE	59306472 D	19-06-1997
		•	DK	675853 T	08-12-1997
			MO	9414704 A	07-07-1994
			EP	0675853 A	11-10-1995
			ES	2105612 T	16-10-1997
WO 8602024	A	10-04-1986	CA	1244526 A	08-11-1988
			ΕP	0195052 A	24-09-1986
			JP	62500290 T	05-02-1987
			US	4818837 A	04-04-1989
			US	RE32908 E	18-04-1989
			US	4725447 A	16-02-1988